

丸文が、ナノテクノロジー機器開発メーカー SCIVAX と代理店契約を締結 ナノインプリント装置（Xシリーズ）を販売開始

エレクトロニクス専門商社の丸文株式会社（社長：佐藤 敬司、本社：東京都中央区、資本金：62億1,450万円 以下 丸文）は、ナノテクノロジー機器開発メーカーである SCIVAX 株式会社（代表取締役：前野 拓道、本社：東京都中央区、資本金：2億5千万円、以下 SCIVAX）と販売代理店契約を締結し、同社が製造するナノインプリント装置 X シリーズの販売を開始することになりましたので、お知らせします。

SCIVAX は、ナノテクノロジー機器開発のベンチャー企業です。同社の X シリーズは、熱式を採用し、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂から各種ガラスまで、様々な材料の精密加工が可能です。また同装置販売に加え、マスタ製作、金型製作、成形材料、評価技術などのサービスを提供しトータルでサポートしています。

丸文では、量産対応を視野に入れ、バイオ解析チップ、プリント配線基板、フラットパネルディスプレイ、ストレージメディアなどのアプリケーションの研究開発及び生産技術開発向けに販売していく考えです。

< SCIVAX 株式会社について >

本 社 : 東京都中央区東日本橋 3-4-10 アクロポリス 21 ビル
設 立 : 2004 年 2 月
代表者 : 代表取締役社長 前野 拓道
従業員 : 24 名 (2005 年 5 月現在)
資本金 : 2 億 5 千万円
事業内容 : ナノインプリント事業、知的財産関連事業、研究開発事業

SCIVAX 株式会社の詳細については、<http://www.scivax.com/> をご覧ください。

< 丸文株式会社について >

本 社 : 東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1
設 立 : 1947 年
代表者 : 代表取締役社長 佐藤 敬司
従業員 : 837 名 (2006 年 4 月現在)
資本金 : 62 億 1,450 万円
売上高 : 2,375 億円 (2006 年 3 月期連結)
事業内容 : 集積回路を中心とした半導体、電子応用機器など、国内外の最先端エレクトロニクス製品を販売する専門商社。北米やドイツの最先端レーザ発振器やレーザ加工機を輸入販売する一方、半導体前工程においては、化合物半導体用の MBE 装置や MOCVD 装置を、後工程では、インライン向け IC 外観検査装置やバーンインテスタなどの検査・製造関連装置を取扱う。

東京証券取引所市場第 1 部に上場。(コード番号 : 7537)

丸文株式会社の詳細については、<http://www.marubun.co.jp/> をご覧ください。

この製品に関するお問い合わせ先

丸文株式会社 システムカンパニー MOT室
担当：鹿嶋

東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1 〒103-8577

TEL:03-3639-8472 FAX:03-3639-2358

E-mail: ykashima@marubun.co.jp

このニュースリリースに関するお問い合わせ先

丸文株式会社 広報室

担当：杉村

東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1 〒103-8577

TEL:03-3639-9803 FAX:03-5644-7693

E-mail: koho@marubun.co.jp

参考

簡易型ナノインプリント装置 Xシリーズ

Xシリーズは、R&D用途に特化した卓上簡易型ナノインプリント装置です。コンパクトな外見ながらも、650 加熱ヒーター(オプション)採用によりガラス成形対応を可能とし、R&D用途において必要十分なスペックを擁します。

項目	仕様	
型式	X-100/200	X-50
インプリントプロセス方式	一括転写方式	一括転写方式
インプリント力	10kN	588N
モールド加熱温度	選択式:最大 250 、 650	最大 650
基板加熱温度	選択式:最大 250 、 650	最大 650
ステージ面内温度均一性	2%以下	2%以下
モールド・基板冷却方式	選択式:空冷、冷却水による強制冷却	外熱式
モールドサイズ	50mm□	30mmφ
基板サイズ	50mm□	30mmφ
基板固定方法	真空吸着、メカニカルクランプ	-
ステージ面内平坦度	1μm 以下	1μm 以下
上下ステージ間平行度調整	調整分解能 200nm	-
外形寸法	H800 × D655 × W780	H750 × D500 × W1100

X-100/200



X-50

